

LANGUAGE:	DE
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S02
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	MarliesSchauenburg
NO_DOC_EXT:	2017-103861
SOFTWARE VERSION:	9.5.4
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	Marlies.Schauenburg@desy.de
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1) **Name und Adressen**

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY

Notkestraße 85

Hamburg

22607

Deutschland

Telefon: +49 4089982480

E-Mail: warenwirtschaft.v4sk@desy.de

Fax: +49 4089984009

NUTS-Code: DE6

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: <http://desy.de>

Adresse des Beschafferprofils: http://warenwirtschaft.desy.de/ausschreibungen/index_ger.html

I.2) **Gemeinsame Beschaffung**

I.3) **Kommunikation**

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://warenwirtschaft.desy.de/ausschreibungen/index_ger.html

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4) **Art des öffentlichen Auftraggebers**

Andere: Stiftung bürgerlichen Rechts

I.5) **Haupttätigkeit(en)**

Andere Tätigkeit: Forschung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1) **Umfang der Beschaffung**

II.1.1) **Bezeichnung des Auftrags:**

EO006-17 Nanolab: Herstellung, Lieferung und Installation eines Rasterkraftmikroskops (AFM) inkl. Training

Referenznummer der Bekanntmachung: EO006-17 Nanolab

II.1.2) **CPV-Code Hauptteil**

38514200

II.1.3) **Art des Auftrags**

Lieferauftrag

II.1.4) **Kurze Beschreibung:**

Herstellung, Lieferung, Installation eines Rasterkraftmikroskops (AFM) inkl. Training/Einweisung:

Das hochauflösende, vielseitige Raster-Kraftmikroskop (AFM) dient zur Charakterisierung von Oberflächen auf Nanoskala mittels unterschiedlicher Raster-Kraft Abbildungsmodi, Rastertunnelmikroskopie, sowie (simultane) Messung von Topographie und lokaler elektrischer Leitfähigkeit, quantitativen Kraft-Modus basierend auf Kraft-

Abstandskurven, Raster Kraftspektroskopie, und Kelvin-Probe zur Messung von Oberflächenpotentialen. Die mit dem AFM zu charakterisierenden Proben umfassen Metall- und Legierungsnanopartikel auf nichtleitenden Oxidsubstraten mit nur einigen Nanometern Durchmesser, Nano-Assemblies, Block Copolymere, poröse Systeme, Komposite und andere nanoskalige Probenoberflächen aller Materialklassen.

Das Raster-Kraftmikroskop muss elektrochemische Analysen in situ in einer elektrochemischen Umgebung ermöglichen.

II.1.5) **Geschätzter Gesamtwert**

II.1.6) **Angaben zu den Losen**

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2) **Beschreibung**

II.2.1) **Bezeichnung des Auftrags:**

II.2.2) **Weitere(r) CPV-Code(s)**

II.2.3) **Erfüllungsort**

NUTS-Code: DE600

II.2.4) **Beschreibung der Beschaffung:**

Herstellung, Lieferung, Installation eines Rasterkraftmikroskops (AFM) inkl. Training/Einweisung:

Das hochauflösende, vielseitige Raster-Kraftmikroskop (AFM) dient zur Charakterisierung von Oberflächen auf Nanoskala mittels unterschiedlicher Raster-Kraft Abbildungsmodi, Rastertunnelmikroskopie, sowie (simultane) Messung von Topographie und lokaler elektrischer Leitfähigkeit, quantitativen Kraft-Modus basierend auf Kraft-Abstandskurven, Raster Kraftspektroskopie, und Kelvin-Probe zur Messung von Oberflächenpotentialen. Die mit dem AFM zu charakterisierenden Proben umfassen Metall- und Legierungsnanopartikel auf nichtleitenden Oxidsubstraten mit nur einigen Nanometern Durchmesser, Nano-Assemblies, Block Copolymere, poröse Systeme, Komposite und andere nanoskalige Probenoberflächen aller Materialklassen.

Das Raster-Kraftmikroskop muss elektrochemische Analysen in situ in einer elektrochemischen Umgebung ermöglichen und die folgenden Spezifikationen erfüllen:

- Auflösung AFM Scanner lateral (x,y): Rauschen < 0.15 nm RMS
- Höhenauflösung, AFM Scanner (z): Rauschen < 30 pm RMS
- Minimaler Scan-Bereich, AFM Scanner (x,y): 80 µm × 80 µm
- Minimaler Scan-Bereich, AFM Scanner (z): 10 µm
- Auflösung des Translationstischs zur Lokalisation ausgewählter Probenregionen: 2 µm
- Der Scan-Bereich des Translationstischs (x,y): muss ermöglichen, auf einem 4" Wafer alle Positionen zu untersuchen, ohne den Wafer neu einbauen zu müssen.
- Auflösung / Bildfeld des Lichtmikroskops: 200-1400 µm / 2 µm
- In-situ Umgebungen für elektrochemische Messungen bis 60 °C und in Flüssigkeit.

II.2.5) **Zuschlagskriterien**

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6) **Geschätzter Wert**

II.2.7) **Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems**

Beginn: 02/10/2017

Ende: 20/12/2017

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10) **Angaben über Varianten/Alternativangebote**

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11) **Angaben zu Optionen**

Optionen: nein

II.2.12) **Angaben zu elektronischen Katalogen**

II.2.13) **Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14) **Zusätzliche Angaben**

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1) **Teilnahmebedingungen**

III.1.1) **Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister**

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

- Aktueller Auszug (nicht älter als 12 Monate) aus dem Berufs- oder dem Handelsregister des Sitzes oder Wohnsitzes des Unternehmens.
- Schriftliche Bescheinigung der zuständigen Behörde, dass der Bieter seine Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben ordnungsgemäß erfüllt hat.
- Schriftliche Bescheinigung der zuständigen Behörde, dass der Bieter seine Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt hat.
- Eigenerklärung, dass keine schwere Verfehlung begangen worden ist, die die Zuverlässigkeit des Bieters in Frage stellt (siehe Vordruck „Eigenerklärung zur Eignung“)

III.1.2) **Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit**

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

- Eigenerklärung, dass kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder ein Antrag mangels Masse abgelehnt wurde (siehe Vordruck „Eigenerklärung zur Eignung“).
- Eigenerklärung, dass das Unternehmen sich nicht in Liquidation befindet (siehe Vordruck „Eigenerklärung zur Eignung“).
- Eigenerklärung über den Gesamtumsatz des Unternehmens bezogen auf die letzten 3 Geschäftsjahre (Angabe pro Jahr)

III.1.3) **Technische und berufliche Leistungsfähigkeit**

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

- Schriftliche Referenzen (mindestens je 1x):
 - für Serienfunktion
 - für Scan-Bereich des Translationstischs (geeignet, um auf einem 4" Wafer ohne Neueinbau des Wafers alle Regionen erreichen zu können.
 - für quantitativen Kraft-Modus basierend auf pixelweisen Kraft-Abstandskurven über bereits erbrachte Leistungen der geforderten Art mit Nennung von Kontaktdaten des Auftraggebers
- Dokumentation über den Aufbau, die Funktionsweise und die geometrischen Abmessungen des gemäß Ausschreibung angebotenen Mikroskops.

III.1.5) **Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen**

III.2) **Bedingungen für den Auftrag**

- III.2.2) **Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:**
Gemäß Vergabeunterlagen
- III.2.3) **Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal**

Abschnitt IV: Verfahren

- IV.1) **Beschreibung**
- IV.1.1) **Verfahrensart**
Offenes Verfahren
- IV.1.3) **Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem**
- IV.1.4) **Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs**
- IV.1.6) **Angaben zur elektronischen Auktion**
- IV.1.8) **Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)**
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
- IV.2) **Verwaltungsangaben**
- IV.2.1) **Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren**
- IV.2.2) **Schlussstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge**
Tag: 01/09/2017
Ortszeit: 23:59
- IV.2.3) **Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber**
- IV.2.4) **Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:**
Deutsch
- IV.2.6) **Bindefrist des Angebots**
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/10/2017
- IV.2.7) **Bedingungen für die Öffnung der Angebote**
Tag: 04/09/2017
Ortszeit: 10:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

- VI.1) **Angaben zur Wiederkehr des Auftrags**
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
- VI.2) **Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen**
- VI.3) **Zusätzliche Angaben:**
1. Die den Vergabeunterlagen beigefügten Formblätter sind zwingend zu verwenden.
2. Angebote sind ausschließlich über den Postweg oder direkt an die unter Ziff. I.1) benannte Stelle zu übermitteln. Elektronische Angebote werden nicht akzeptiert.
- VI.4) **Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren**
- VI.4.1) **Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren**
Vergabekammer des Bundes
Villemombler Str. 76
Bonn
53123
Deutschland

VI.4.2) Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren**VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen**

Genauere Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Genauere Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

a) Gemäß § 134 Abs.2 GWB darf ein Vertrag erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information über die geplante Auftragsvergabe an die nicht berücksichtigten Bieter geschlossen werden. Wird die Information per Fax oder auf elektronischem Weg versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Tage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter oder Bewerber kommt es nicht an.

b) § 160 Abs. 3 GWB: Der Antrag auf Einleitung des Nachprüfungsverfahrens ist unzulässig, soweit:

(1) der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb von 10 Tagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs.2 GWB bleibt unberührt

(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden

(3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

(4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

VI.4.4) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Vergabekammer des Bundes

Villemombler Straße 76

Bonn

53123

Deutschland

VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

28/07/2017